文章编号:1672 - 2477(2006)03 - 0042 - 04

# PET 基纳米 ZnO 膜的 溅射沉积及 AFM 表征

## 李良飞<sup>1</sup>,侯大寅<sup>1</sup>,魏取福<sup>2</sup>

(1.安徽工程科技学院 安徽省纺织面料重点实验室,安徽 芜湖 241000;2.江南大学 生态纺织教育部重点实验室,江苏 无锡 214122)

摘要:在纺织材料表面进行 ZnO 镀层处理,能赋予聚合物纤维表面以特殊的光电功能.利用磁控溅射法在 PET 非织造布表面制备出颗粒均匀、细致、稳定的纳米 ZnO 薄膜.利用原子力显微镜(AFM)对不同参数下制 备的 ZnO 薄膜表面形貌进行表征,分析了不同溅射加工条件对 ZnO 薄膜表面形态的影响.

关键 词:纳米 ZnO;磁控溅射;原子力显微镜

中图分类号:TN16 文献标识码:A

纳米 ZnO 是一种面向 21 世纪的新型高功能精细无机产品.纳米 ZnO 由于颗粒是纳米级,粒径小、比表面积大,其表面电子结构和晶体结构发生变化,因而具备普通 ZnO 颗粒所不具有的表面效应、小尺寸效应和量子效应,具有独特的物理和化学性能、光催化性能及散射能力.纳米 ZnO 不仅能够屏蔽波长在 200~400 nm 的紫外线,而且还具有广谱抗菌、防臭功效<sup>[1,2].</sup>在化妆品、涂料、光电子、图象记录材料、生物、纺织材料等领域有广泛地应用前景<sup>[3]</sup>.

纳米 ZnO 作为表面功能整理剂用于纺织材料上,主要采用以下几种方法:一种是在纺纱过程中加入, 但这种方法对纺纱过程带来困难和化学污染;第二种是涂层法,借助黏合剂将氧化锌颗粒涂于织物表面; 最后一种方法是整理法,在织物加工过程中将其附在纺织材料表面.后两种方法涂层颗粒不均匀,持久性 差,而且影响织物的手感<sup>[4]</sup>.

磁控溅射法是利用磁场强大的能量轰击溅射靶材,在材料表面沉积纳米薄膜,制备的纳米薄膜具有均匀、稳定,没有化学污染且不改变材料本身性能等优点<sup>[5]</sup>.磁控溅射方法用于金属和无机材料表面成膜已 有一定的研究,但是在纺织高分子材料上溅射成膜的研究尚不多见.本文利用磁控溅射技术在 PET 非织 造布表面沉积纳米 ZnO 膜,探索一种新的纺织材料表面功能化改进的方法.

#### 1 磁控溅射原理

磁控溅射是一种在精确控制之下快速沉积纳米膜的技术.图1为磁控溅射原理图.通过辉光放电使保护 气体氩气与电子发生碰撞电离出 Ar<sup>+</sup>和新的电子 e, Ar<sup>+</sup>在电场的作用下以高能量轰击靶材,使靶材发生溅 射并沉积在基材表面.



### 2 实验部分

#### 2.1 实验材料与仪器

本实验基材选用江西国桥纺织有限公司生产的 PET 纺粘法非织造布(60 g/cm<sup>2</sup>),溅射靶材选用纯度 为 99.99 %ZnO 陶瓷压片(450 mm x4 mm).利用沈阳聚智科技有限公司生产的JZCK-420B 高真空多 功能磁控溅射仪,配置直流和射频电源.本实验采用射频电流,频率为 13.56 MHz,功率范围 6 ~ 300 W.

收稿日期:2006-03-28

基金项目:教育部科学技术研究重点资助项目(106089) 作者简介:李良飞(1980 —),男,安徽亳州人,硕士研究生.

#### 2.2 PET 表面纳米 ZnO 膜的构建

实验前 PET 非织造布先经过丙酮溶液浸泡,用 KQ - 50B 型超声波清洗器清洗,并用蒸馏水反复清洗以除去 PET 非织造布表面灰尘和油渍等各种污染物,然后放入烘箱进行烘燥,烘箱温度控制在 60 左右,烘燥 5 min 后放入干燥皿中待用.

实验采用磁控溅射射频电流源,Ar 气为保护气体,气体流量为 20 sccm.先开机械泵和分子泵抽真空 室本底压强至 5.0 ×10<sup>-4</sup> Pa,靶材与基材的距离为 60 mm.实验前利用 Ar 离子对靶材进行 5 min 预溅,以 清洗靶材表面的杂质.

2.3 纳米 ZnO 膜的 AFM 表征

原子力显微镜(AFM)具有扫描范围广、分辨率高等优点.扫描范围水平分辨率 0.1 nm,垂直分辨率 0.01 nm,并且可以对样品进行三维成像,而且在室温条件下就可以进行扫描<sup>[6]</sup>.

使用 <u>CSPM4000 扫描探针显微镜(内含原子力显微镜)</u>对溅射前后 PET 纤维表面形貌进行成像分析. 探针扫描模式为接触模式,扫描最大范围是 20 µm ×20 µm ,扫描频率为 1.0 Hz. 通过后处理软件对 ZnO 膜表面形貌和颗粒粒径大小进行分析.

#### 3 纳米 ZnO 膜的沉积工艺探讨

磁控溅射沉积的纳米 ZnO 薄膜表面形态主要受溅射时间、溅射压强、溅射功率的影响.

3.1 溅射时间

在溅射压强为 2.0 Pa 和溅射功率 180 W 的前提下,调整溅射时间分别为 30 min、45 min、100 min 来 制备纳米 ZnO 薄膜.图 2a、b 分别是溅射前 PET 纤维表面的 AFM 二维和三维图像.扫描范围是 3 µm x3 µm.从图中看到溅射前 PET 纤维表面相对比较平滑,表面凸起的颗粒状大概是纤维本身残留的杂质.



图 3a、b、c 分别是不同溅射时间后 PET 表面形貌,经过磁控溅射 30 min 之后的 AFM 成像表面形貌 显示 PET 纤维表面已经沉积了由颗粒相对均匀的粒子组成的纳米 ZnO 薄膜,但是纳米 ZnO 颗粒还未能 完全覆盖在 PET 纤维表面 ,这是因为在很短的时间内 Ar <sup>+</sup> 轰击 ZnO 靶材的能量比较小 ,因此沉积到纤维 表面的离子和原子密度比较小 ,从 CSPM4000 处理软件中得知 ZnO 颗粒粒径大约为 61 nm.

当其他条件不变,溅射时间为 45 min,从 AFM 图像上我们可以很清楚的看到一层比较细致均匀的纳 米 ZnO 颗粒沉积在纤维表面,而且晶粒已经完全覆盖在 PET 纤维表面,颗粒粒径大约是 48 nm.

继续延长溅射时间到 100 min,从 AFM 图像可以看到 PET 纤维表面已经被纳米 ZnO 完全覆盖上 了,颗粒很细致、均匀,颗粒粒径为26 nm,这说明随着溅射时间的延长,从ZnO靶材中溅射出的原子数目 增多.加快了原子的生长速度.沉积到纤维表面的离子和原子密度随之增加.颗粒粒径变的更加细小,得到 的纳米 ZnO 更加均匀.

#### 3.2 溅射压强

· 44 ·

图 4a、b、c 分别是在保持溅射功率 180 W 和溅射时间 60 min 的条件下,调整溅射压强分别为 1.0 Pa、 2.0 Pa、2.5 Pa、分析 ZnO 成膜的变化.



a 1.0 Pa

图 4 不同溅射压强 PET 表面 AFM 形貌

从图 4a、b 中我们看到当溅射压强在 1.0 Pa 和 2.0 Pa 的时候、纳米 ZnO 颗粒的大小和分布形态没有 很明显的变化,颗粒粒径范围在 35 nm 左右,增大溅射压强为 2.5 Pa 时,纳米 ZnO 颗粒形状明显变差,颗 粒已经产生了局部的团簇,如图 4c, 这主要是压强增大,真空反映室里放电空间的带电粒子的自由程减 短,导致 ZnO 粒子获得的能量减小,降低了粒子表面迁移率,限制了 ZnO 晶粒的生长.

#### 3.3 溅射功率

图 5a、b、c 是在保持溅射压强 2.0 Pa 和溅射时间 60 min 的条件下,分别调整溅射功率为 100 W、 140 W、160 W 时的 AFM 成像. 颗粒粒径分别为 23 nm、40 nm、69 nm. 这说明随着溅射功率的增大, 颗粒 尺度也随之增大,这是因为随着溅射功率增大,导致 Ar 离子轰击 ZnO 粒子的速度加快,单位时间溅射出 的更多的 ZnO 粒子,导致了较大的晶粒生成.



a 100 W(23 nm)

b 140 W(40 nm) 图 5 不同溅射功率 PET 表面 AFM 形貌

c 160 W(69 nm)

© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

#### 4 结 论

利用磁控溅射在 PET 表面制备的纳米 ZnO 薄膜,随着沉积时间的延长,薄膜的厚度逐渐增加,非织造布表面 ZnO 纳米结构薄膜的致密性、均匀性越来越好,并呈连续覆盖纤维表面的状态,在压强为 2.0 Pa,功率为 180 W 时,溅射时间为 100 min 时制备的 ZnO 晶粒分布最均匀;工作气体压力主要影响 ZnO 晶粒形状和结晶态,在功率为 180 W,溅射时间为 60 min 时,压强在 2.0 Pa 左右,ZnO 晶粒形状和结晶态 比较好;而溅射功率的大小影响 ZnO 晶粒的生长,较高的溅射功率加速了晶粒生长,在压强为 2.0 Pa,溅射功率在 100 W 时,ZnO 颗粒粒径最小.

### 参考文献:

- [1] Ohshima K, Tsuto K, Okuyama K, et al. Preparation of ZnO- TiO<sub>2</sub> composite fine partcles using the ultrasonic spray pyrolysis method and the characteristics on ultraviolet cut off [J]. Aerosol Science and Technology, 1993, 19 (4):468 477.
- [2] 李彦峰,汪斌华,黄婉霞,等.纳米无机抗菌材料抗菌性能研究[J].化工新型材料,2002,30(6):44-46.
- [3] 韩冬,任湘菱,陈东,等.纳米 ZnO的制备及其光催化性能研究[J].感光科学与光化学,2005,23(6):414.
- [4] 王世敏,徐祖勋,傅晶.纳米材料制备技术[M].北京:化学工业出版社,2002.
- [5] 杨文茂,刘艳文,徐禄祥,等. 溅射沉积技术的发展及其现状[J]. 真空科学与技术学报,2005,25(3):204-205.
- [6] Wei Qufu, Wang Xueqian, Gao Weidong. AFM and ESEM Characterisation of Functionally Nanostructured Fibres[J]. Applied Surface Science, 2004, 236:456 - 460.

# Sputtering ZnO nano films on PET substrate and the surface characterization by AFM

LI Liang-fei<sup>1</sup>, HOU Da-yin<sup>1</sup>, WEI Qu-fu<sup>2</sup>

(1. Anhui Provincial Key Laboratory of Textile Fabric , Anhui University of Technology and Science , Wuhu 241000 , China ;
2. Key Laboratory of Science & Technology of Eco-Textile Ministry of Education , Southern Yangtze University , Wuxi 214122 , China)

Abstract: The polymer fibers have photoelectricity particularly by plating ZnO films on the surface of textile materials. Nano- ZnO thin films were prepared by magnetron sputtering on the Polyethylene Terephthalate (PET) nonwoven fabric substrates. The nano- ZnO grains were uniform and stably prepared by magnetron sputtering. The surface topography of the ZnO thin film was observed by the Atom Force Microscopy (AFM) under the different technical parameters, analyzing the influence of the surface shape of ZnO which was prepared under different sputter parameters. The paper searches for a new method of the surface functional finishing of the textile materials.

Key words:nano - ZnO; magnetron sputtering; Atom Force Microscope